OPTICAL SYSTEM AND OBJECT INSPECTING METHOD USING THE SAME

Publication number: JP10104171

Publication date: 1998-04-24 Inventor NUSS MARTIN C

Applicant: LUCENT TECHNOLOGIES INC

Classification:

. international

G01D5/26: G01J3/28: G01N21/35: G01N22/00: G01N22/02; H01Q3/26; H01Q9/28; H01S1/02;

G01D5/26: G01J3/28: G01N21/31: G01N22/00: H01Q3/26; H01Q9/04; H01S1/00; (IPC1-7): G01N22/02;

G01D5/26: G01N21/35: G01N22/00 G01.I3/42: H01Q3/26G: H01Q9/28B

- European: Application number: JP19970243654 19970909

Priority number(s): US19960711146 19960909

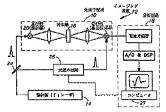
Also published as:

EP0828143 (A2) US5789750 (A1) EP0828143 (A3)

Report a data error here

Abstract of JP10104171

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the parallel beams without curving of the wave front by providing an optical element for collimating the emitted radiation within a specified frequency range into a beam with diameter independent of the frequency and has no curving of the wave front, a beam detector and the like. SOLUTION: An imaging device 12 comprises a light emitting source of repeating optical pulses for a specified time length, an optical-element arrangement. which forms the radiation wave of THZ(tera hearz) and detects the reflected radiation wave transmitted through the medium of an object 16 or reflected by this medium, and an analyzing circuit 18. The optical-element arrangement 10 comprises a THZ wave transmitter 20, whose gate is optically controlled, and a THZ wave detector 22. A variable optical delay circuit 26 changes the optical delay between respective processing pulses controlled by a computer 27. A dipole antenna is used for constructing both of the THZ wave transmitter 20 and the THZ wave detector 22. A substrate lens advances the coupling into the free space and the collimating process of the electromagnetic radiation wave.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list 4 family members for: JP10104171 Derived from 3 applications Back to JP1010

1 Optical system employing terahertz radiation

Inventor: NUSS MARTIN C (US)

Applicant: LUCENT TECHNOLOGIES INC (US)

EC: G01J3/42; H01Q3/26G; (+1) IPC: G01D5/26; G01J3/28; G01N21/35 (+16)

Publication info: EP0828143 A2 - 1998-03-11 EP0828143 A3 - 1998-08-26

2 OPTICAL SYSTEM AND OBJECT INSPECTING METHOD USING THE SAME

Inventor: NUSS MARTIN C

Applicant: LUCENT TECHNOLOGIES INC

EC: G01J3/42; H01Q3/26G; (+1) IPC: G01D5/26; G01J3/28; G01N21/35 (+16)

Publication info: JP10104171 A - 1998-04-24

Optical system employing terahertz radiation

Inventor: NUSS MARTIN C (US)

Applicant: LUCENT TECHNOLOGIES INC (US)

EC: 60113/42: H0103/266; (+1)

IPC: 601D5/26; 601J3/28; 601N21/35 (+14)

Publication info: US5789750 A - 1998-08-04

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-104171

(43) 公開日 平成10年(1998) 4月24日

(51) Int.CI.4		識別記号	FΙ		
G01N	22/02		G 0 1 N	22/02	С
G01D	5/26		G 0 1 D	5/26	Н
G 0 1 N	21/35		G 0 1 N	21/35	Z
	22/00			22/00	S

審査請求 未請求 請求項の数25 OL (全 11 頁)

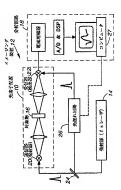
(21)出願番号	特願平9-243654	(71) 出頭人	596077259
			ルーセント テクノロジーズ インコーボ
(22)出顧日	平成9年(1997)9月9日		レイテッド
			Lucent Technologies
(31)優先権主張番号	08/711146	1	Inc.
(32) 優先日	1996年9月9日		アメリカ合衆国 07974 ニュージャージ
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ー、マレーヒル、マウンテン アベニュー
(,,,,,,,,,,			600-700
		(72)発明者	マーティン シー・ナス
			アメリカ合衆国、07704 ニュージャージ
			ー、フェア ヘプン、リンカーン アベニ
			a- 146
		(74)代理人	弁理士 三俣 弘文
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光システム及びこれによる対象物調査方法

(57)【要約】

【課題】 改善された空間解像度を有するTHz輻射波 光システムの提供。

「解決手段!」 本界明の一架結例に基づいて構築された 光システム10'が、100GHz~20THzの開設 数範囲において輻射波を発射するための発射線と、同発 射源によって発射された輻射波を自由空間かへ結合する ための結合用レンズ構造であって結合輻射波の波長が結 合用レンズ構造の出口ひとみにおけるだーム単位の1/ 100より大きいような結合用レンズ構造を有する系ி級 数にほぼ無関係であり波面の湾曲がまぽないビーム、に エリメートするための少なくとも1個のコリメート用光 素子40と「関心文くとも1個のコリメート用光 素子40と「関心文くとも1個のコリメート用光素子 0によってコリメートされたビームを検出器22に指向 するための外集用形式等42と:指向されたビームを検 出するための機和器22と:かなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 100日日 2-20 TH 2 の開放教範囲 において輻射波を発射するための発射波と、議発射源に よって発射されて輻射波を自由空間内・結合するための 結合用レンズ構造であって、結合輻射波の減長が結結合 用レンズ構造の出口ひとみにおけるビーム直径の1/1 101より大きいような、結合用レンズ構造と、受信され た結合偏射波を、ビーム直径が開波数にほぼ無関係であ り且つ波面の消曲がほぼないビームにリメートするた めの少なくとも1個のコリメート用光素子と、速少なく とも1個のコリメート用光素子と、速少な とも1個のコリメート開光素子にあつてコリメートされ たビームを検出するための検出器と、からなることを特 彼とする、THL輻射波を用いる光ンステム。

【前末項2】100GH2~20TH2の開放販売間において輻射波を発射するための発針面と:該発料率によって発射された輻射波を自動で開かく結合するための 第1の結合用レンズ構造と、受信された結合輻射波を、限定即所集束スポット上へ集束させるための、少なくとも「個の光素子と、該少なくとも「個の光素子と、該少なくとは、一般を表した。 ととや特徴とする、TH2電射波を用いる光システム、【請求項3】 前記売射波が、差板の第1の疾血に形成されて無対なケイボール売射器を有し、前記結合用レンズ構造が、該板の第2の表面上に形成されたまなり、といいでは、20世紀を11年である。ことを特徴とする請求項3】に新板が第2の表面上に形成されたまなり、20世紀を11年である。

【請求項4】 物証基板レンスが超半年販売が採せる 日、前記基板リンスの中心と 前記基板リンスの中心と 防証差板の前距割 の表面 とか明能され、 該明施定機が、 前配グイボール発射器を 有する前距発射源のゲイボール機対コーン内で発射されたほぼ全ての光線の、自由空間インタフェース部へ 総対施反射に対する臨 界角よりも小さくなるような距離である、ことを特徴と する請求項 3の光システム。

【請求項5】 前記検出器がダイボール受信器を有する ことを特徴とする請求項3の光システム。

【請求項6】 前記結合用レンズ構造が第1の結合用レ ンズ構造であり、前記検出器が更に、

第2の結合用レンズ構造と;コリメートされた輻射波を 該第2の結合用レンズ構造内へ集中するための集中用光 素子と;を有し。

該第2の結合用レンズ構造が、該集中された輻射波を自 由空間から前記ダイボール受信器へ結合するように作動 する。ことを特徴とする請求項4の光システム。

【請求項7】 前記検出器が電気光学受信器を有することを特徴とする請求項1の光システム。

【請求項8】 前記少なくとも1個のコリメート用光素 子が、コリメートされた輻射波を調査対象の媒質に指向 するような寸法及び配置を有し、 前記検出器が、前記少なくとも1個のコリメート用光業 子に関して、該鉄質を選して透過されるコリメートされ たが開放を受信するように、配置される、ことを特徴と する請求項1の光システム。

【請求項9】 前記少なくとも1個のコリメート用光素 子が、コリメートされた輻射波を検討対象の嫁費へ向け るような寸法及び配置を有し、

前記検出器が、前記少なくとも1個のコリメート用光素 子に関して、前記媒質によって反射されるコリメートさ れた無射波を受信するように、配置される、ことを特徴 とする請求項10光ンステム。

【請求項10】 前記結合用レンズ構造が第1の結合用 レンズ構造であり、

前記検出器が更に、

第2の結合用レンズ構造と:限定回所集束スポット上へ 集束された輻射波を該第2の結合用レンズ構造へ指向す あための少なくとも1個の集単形差帯では。それ 該第2の結合用レンズ構造が、該指向された輻射波を自 由空間から前記グイボール受信器へ結合するように作動 する。ことを構造する音数では、

【請求項11】 前記少なくとも1個のコリメート用光 素子が、輻射波を検討対象の媒質内の限定回折集束スポット上へ集束させる動作を行うように配置され、

前記検出器が、該限定回折集束スポット上へ集束され該 媒質を通して透過された輻射波を受信する動作を行うよ うに配置される、ことを特徴とする請求項9の光システ ム。

【請求項12】 前記少なくとも1個のコリメート用光 素子が、輻射波を検討対象の媒質内の限定回折集束スポット上へ集束させる動作を行うように配置され、

前記検出器が、該限定回折集東スポット上へ集束され該 繋質によって反射された朝針波を受信する動作を行うよ うに配置される、ことを特徴とする請求項9の光システ か

【請求項13】 THz光システムで用いられるレンズ 配置であって、

該レンズ配置が、

発射源によって100GHz~20THzの周波数範囲 で発射された輻射波を自由空間内へ結合するための第1 の結合用レンズ構造と、

受信された結合輻射波を、ビーム直径が周波数にほぼ無 関係であり且つ波面湾曲をほぼ持たないビームにコリメ ートするための少なくとも1個のコリメート用光素子 と:からなり、

該発射された輻射波の波長が該結合用レンズ構造の出口 ひとみにおけるビーム直径の1/100より大きい、こ とを特徴とする、THz光システムで用いられるレンズ 配置。

【請求項14】 前記結合用レンズ構造が第1の結合用 レンズ構造であり、 前記レンズ配置が更に、

第2の結合用レンズ構造と;コリメートされた輻射波を 該第2の結合用レンズ構造内へ集中するための集中用光 素子と;を有し、

該第2の結合用レンズ構造が、該集中された輻射波を自 由空間から受信器へ結合する動作を行うように配置され る。ことを特徴とする請求項13の配置。

【請求項15】 THz光システムで用いられるレンズ 配置であって、

該レンズ配置が、

発射源によって100GHz~20THzの周波数範囲 において発射された輻射波を自由空間内へ結合するため の第1の結合用レンズ構造: 受信された結合輸射波 を、限定回折集束スポット上へ集束させるための、少な くとも1個の光素子と;からなる、ことを特徴とする、

THz光システムで用いられるレンズ配置。 【請求項16】 前記結合用レンズ構造が、基板の第1の表現した必然された基板といってある。

【請求項16】 制記録音用レンス権迫が、基故の第1 の表面上に形成された基板レンズを有することを特徴と する、請求項13又は請求項15の配置。

【請求項17】 前記基板レンズが、超半球形の形状を 有し、前記基板レンズの中心と前記基板の前記第1の表 面とが、前記基板レンズの半径を前記基板レンズの屈折 事で除した値よりも大きくない距離だけ隔離されてい る、ことを特徴とする請求項16の配置。

【請求項18】 前記基板レンズが無球面収差であることを特徴とする請求項17の配置。

【請求項19】 前記基板レンズが半球であることを特徴とする請求項16の配置。

【請求項20】 前記結合用レンズ構造が第1の結合用 レンズ構造であり、

前記レンズ配置が更に、

第2の結合用レンズ構造と:限定回折集束スポット上へ 集束された輻射波を該第2の結合用レンズ構造へ指向す るための少なくとも1個の集束用光素子と:を有し、

該第2の結合用レンズ構造が、該指向された輻射波を自 由空間から受信器へ結合する動作を行うように配置され ることを特徴とする請求項15の配置。

【請求項21】 発射源によって100GHz~20T Hzの周波数範囲で発射された輻射波を用いて対象物を 調査する方法であって、

該方法が、

議発射解によって発射された輻射波を、第1の結合用レンス構造を用いて、結合輻射波の波長が該第1の結合用レンス構造の出口じとみにおけるビーム直径の1/10 しより大きくなるように、結合するステップと、受信された結合輻射波を、ビーム直径が開成数にはば無関係であり且つ次回隙油をはば特たないビームにコリスートするステップと: コリメートされた輻射波を、調整対象の探賞に指向するステップと: 該指向ステップの間に該数質に指向するステップと: 該指向ステップの間に該数質に指向するステップと: 該指向ステップの間に該数質に れた輻射波の1つを検出するステップと;からなること を特徴とする、輻射波を用いて対象物を調査する方法。 【請求項22】 発射源によって100GHz~20T Hzの開波数範囲で発射された輻射波を用いて対象物を 調査する方法であって、

該方法が、

議発射額によって発射された輻射波を、第1の結合用レンス構造を用いて、自由空間外へ結合するステップと; 受信された結合解辨波を、開金対象の異信に通門と 定回所低東スポット上へ無東するステップと; 該線東ス テップの間に該越質によって反射された輻射波及び該集 質を進して透過された輻射波の1つを検出するステップ と; かみなることを特徴とする、輻射波を用いて対象物 を調査する方法。

【請求項23】 前記基板レンズが、超半球形の形状を 有し、前記基板レンズの中心と前記基板の前記第10表 面とが、前記基板レンズの半径を前記基板レンズの屈折 事で除した値よりも大きくない距離だけ隔離されてい る。ことを特徴とする請求項3の光システム。

【請求項24】 前記基板レンズが無球面収差であることを特徴とする請求項23の光システム。

【請求項25】 前記基板レンズが半球であることを特徴とする請求項3の光システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、頼して電磁波スペクトルのTHz (テラヘルツ)又は途券が線領域の、度 りよれなは透過された興射波を用いて種々の解質すなわち対象物(オブシェクト)を開査するシステム及び方法に関し、詳しくはこのようをシステムにおいて順射波を がしたして集束(フォーカス)するための配置に関する。

[0002]

【健本の技術】電電波スペクトルの下日よ又は遠途外線 原域、独特の特徴を有する。例えば、THz波は、紙、 原紙、プラスチック、及び重度の厚さの多くの情性体、 のような大低の針を温度の別葉物を容易ト電通するが、有 低性材料及び液体には吸収される、半導体内のキャリヤ はこの循環において強い調整性反応を示すが、金属はT Hz輻射波に対しては完全に不伝導性である。水蒸気、 アンモニア、塩素、等の存極性気体はスペクトルのこの が成に、強いゼレオ県不は常知る吸収器を有する。

【0003】その結果、スペクトルのTH 2 頻繁は、気体の調解接を、プラスチック及び複合料料の品質管理、バッケージ検査、及び水分分析のような用途にますます重要になりつつある。これらの特徴は、TH 2 両波数領域における結構処理 (イメージング) にも用いることができる [文蔵: Muss, IEEE Circuits and Devices, March 1996参照】。

【0004】加えて、THz周波数領域は、分光学の分

野においても相当な関心を持たれている。例えば、半導 体及び金属の電子的性質は、その状態のエネルギーがT 日 2 の光子 (フォトン) に共鳴するような束縛状態 (例、監視ステルターが、サールトを終去を呼ば

(例:励起子及びクーバー対)から大いに影響を受ける。

【0005】THz周波数領域は又、トンネル掘削や準 粒子散乱のような、固体内での非弾性プロセスの処理速 度(レート)とも一致する。更に別の例として、量子井 戸のような人工的に合成された微細棒造における閉じこ めエネルギーはTHz周波数電弧めたよる。

[0006] その潜在能力に刳わらず、適切なツールがないために、分光学及びイメージングのアリエマ臨紀 ラの使用が妨けられてきた。例えば、ミリ波及びサブミリ波用の掃引間波数方式の間波数合成器は振略100日日2よりも低い範囲に周波数が制限されるため、これより高い間波数を得るには個別の間波数源を用いるしかなかった。

【00071他方、フーリエ突換赤外線分光学(FTIR)では、非コヒーレント光源の輝度不足からTHュ電磁信号の使用が妨げられた。加えて、FTIRの方法は、もし応答関数の実数部かと虚数部分とを各層波数ごとに測定する必要がある場合には、有用ではない。

【0008】最後に、電磁波のTHz範囲を用いる実時間イメージングは、この周波数範囲での検出器の感度が悪いために可能となっていない。

[0009]上記の不具合を克服した新しい分光学的イメージング手法が、米国特許出願第08/388,933 (Title:"Nethod and Apparatus for Terahertz Imaging") (木鷸の出順人と同一の出順人Lucent Technologie s) に開示されている。こに同出期金体を本出願の参す文献とする。同文版の丁HL("T-ray") 子契は、超短レーザパルス(すなわち数フェムト秒(fs)台以下)の助けを将て光学電子呼以上成された電磁出意現象(高級電磁波)に表示る低出高度現象(高級電磁波)に表示く私のである。

【0010】これらの下日と過渡電波校は、一般に1ビ コ粉(rs)よりも短い時間長との電磁機制波の発期別バーストである。これらのバーストのスペタトル密度は一般 に、100GH x よりも下から5TH x よりも上までの 製団にわたる。米学的はゲート制度された機比を行うこ とによって、1 p s の数分の1の時間解復度でのTH z 電界の直接測途が可能となる[文號:Smith et al., IEE

【○○11】この測定から、固体、液体、又は気体の組 成物である媒質、の誘電体関数の実数部分及び虚数部分 の両方が急速日-商庫な仕力で導出される。更に、これ ら下日と過渡電波の頻度は従来の熱的免制部の頻度を 超えるものであり、ゲート制備された機出の速度はボロ メークを用いた機出による密度よりら数看高い。

【0012】新材料の特性特定及び基礎物理現象の調査 研究が進む以上に、THz分光学及びイメージングを活 用できる多くの潜在的用途についての場解が高まりつつ ある「文献: Nass、IEEE Circuits and Devices, March 1996、pp. 25-30]、有頭な用途としては、工業無貨管理 及びプロセス制御、パッケージ検査、水分分析、汚染御 定、化学分析、ウエハ特性特定、遠隔探査、及び環境探 査がある。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これら用途の開発を成功させるためには、重要な情度要素の1つとして、「日より光学光を実要できるように高い物画が高いません。「日本の大学光と大テム、光学系)が必要である。上記の用途に対しては、特に、まずTHェ信号を、平行なそして回折が限度以内に限定されると一ム(限定回折ビーム)にコリメートし、次に、可能と最高の空間が健康を含みために、これの「日本ビームを、回折が限度以内に限定される(限定回折)集束点(スポット)上に集束することのできる光学配置が必要であることを、本発明と対理を

[0014] 可規矩則に設計された光システムの場合と 異なり、円よっ電磁信号の放表は、用いられる光素子の サイズに比べて無視できず、又回前効果は光か伝搬を左 右することがあり得る。 したがって、光システムは、列組ます。 呼組まする。 更に、 THと米ビームシステムは、THと 信号によってカバーされる100日によりも下から5 THとよりも上までの広い周波数範囲にわたって作動する必要がある。

【0015】本発明によれば、従来の技術において用いられる光システムの制約を克服することができる [文献:Van Exter et al., IEEE Trans. Microw. Theor. Techn., vol. 38, 1684-1691, 1990]。

[0016] この場合の刺物とは、例えば、ビーム直径 が間破数に無関係で、より長い距離にわたって伝数でき る、平行な限矩回所ビームを生成できないこと、波面の 湾曲のない平行ビームを得ることができないこと[文 蔵:Cheville et al., Appl. Phys. Lett., vol 67, 196 6-1962 (1995)]、基板レンズにはける総件部反射によ る光規失があること[文献:Jepsen 8; Kelding, Opt. Le tt., vol 20, 807-899,1995]、及び広帯域のTH 2 編 射波と、限定回所集束スポット上へ集束できないことで ある。

[0017]

【課題を解除するための手段】本発明によれば、上記の 課題を解決するための手段は、改善された処理能力と、 光ビーム性能と、空間解像度とを有する光システムであ り、両システムにおいては、THェク光学、THェイメ ージング、及びその他の調金手段に有用な報討波を、高 効率な手法で、例えば光伝線イイボールアンテナのよう なTHェ輻射波の送受信装置へそして同装置から(すな わち隔接置との間を)指向性を持たせて結合することが できる「女能ご気は中 tdi、同日の ↓ Quantum [25] r., vol 24, 255-260, 1988].

[0018] 本売明の一実施修に基づいて構築された光 システムは、100GHz~20THzの開途敷発開に さいて輻射波を発射するための発射限と、同発消源によ って発射された輻射波を自由空間から結合するための結 合用シンズ構造であって、熱合輻射波の液長が順路 レンズ構造の出口じとみ(exit pupi)におけるビーム直 径の1/100より大きいような、結合用レンズ構造と からなる。

【0019】開光システムは更に、受信された結合輻射 波を、ビーム直径が周波数には収無関係であり且つ波面 の湾曲がほばないビームにコリメートするための少なく とも1個のコリメート用光素干と、同少なくとも1個の コリメート用光素干とはってコリメートされたビームを 検出するための検出器と、からなる。

[0020]本売卵の別の実施例に基づいて構験された 光システムは、100GHz~20THzの開放教範囲 において輻射液を発射するための発射源と:同発性源に よって発射された輻射液を自由空間内へ結合するための 第10結合用レンズ精造と:受信された結合輻射液を、 限定回所集取スポット上へ集束させるための、少なくと も1個の光素子と:同少なくとも1個の光素子によって 集立れた輻射液を検出するための検出器と:からな る。

[0021]

【発明の実施の形態】図1に、本発明の一実施附に基す く、下14(ラウルツ)ビームを即形限度を実施す さる光素子配置10を示す。説明の便宜上、光素子配置 10は米短特許出間第08/388,933 (Title: Net thod and Apparatus for Terahert Lassing*) に開示さ れている極類のイメージング装置に用いられたが概を示 す。しかし、本発明に基づいて構築されたシンズ配置 が、例えば遊解接塞、照準、及び組成分析等をむより なを記録系に変換可能であることは、この分野の当業 者には祭長に解すてきるととなる。

[0022] いずれにせよ、図1のイメージング装置1 2は、時間長さfs(フェルト砂)台の繰り返し光パル みの発料額14(fsレーザ)と、下日2輻射後を生成 して、対象物16のような調査対象の確質に指向し、こ の解質を選して割着されてはこの練質によって反射され た輻射波を検出する光素子配置10と、概して符号18 で示すが何間路とからなる。

[0023] 発射額14は耐えば800mmに近い液長 及び一般的な約100MH2のパルス輸り返し速度を有 するTiサフィイヤレーザのような関係レーザとして構 成してもよい。又代わりに、発射額14を、1.5μm に近い液長で作動する、時間長さfs台のB・添加フィ パレーザ(fsレーザ)として構成してもよい。

【0024】図1に示す実施例において、光素子配置1 0は、光学的にゲート制御されるTHz波送信器20と 光学的にゲート制御されるTHz液検出器22とからなる。コンピュータ27に制御されて可変の光遅れ回路26が各ゲート処理パルス間の光遅れを変化させる。

【0025】 推奨生態附において、近路路20及び受信 器22は光伝導スイッチとして構成され、半導体基板表 面上に付着させた送信回路稍適内の間線(キャップ)を 架橋する半導体からなる。光伝導スイッチの製作に用い られる材料は、用いられる発射源の動作波長によって定 まる

【00261約800nmより短い被長で作動するfsレーザに関連して用いられる私伝導スイッチに適した材料は、例えば放射機損傷させたシリコン・オン・サファイヤ(RDーSOS)、GaAs、及び低温成長させたるGaAs(LTーGaAs)がある。1.5点mに近い波長で輸動するレーザと共に用いられる光伝導スイッチの製作に適した材料の他の形として、低温成長させた1 「GaAs XI tin GaAs / 1 nAl As 量子井戸が挙げたれる【文章だすはあれまむ」は、Appl. Phy. Let t., Vol. 65 pr. 1790-1792(1994)

【0027】この配置の動作を説明すると、送信器において、光伝導スイッチに電圧がかけられる。光少ルスに ある光キャリルの起入後、スイッチを遇る電流が非常に 急速に足見し、それから半端体のキャリヤ寿命によって 与えられる時定数で演奏する。過渡光電流ゲフクスフェ ルの訳に基づいて自由空間やへの放射を行う。検出器に おいて、電流電圧増幅器(又はアンメータ)が電圧パイ アスを置換する。

[0028] 入制下日ェバルスの電界によって、光キャ リヤの駆動フィールド (場) が得られる。円12フィー ルドと光キャリヤとの両方が存在する場合にのみ電流が スイッチを流れる。電子的手法では下1日2海電電液を直 接に現定するのに必要な速さかないので銀り返し光に赤 サンプリング手が用いるれる。もし光キャリヤの寿命 ェがTHュバルスよりも遅かに短い場合には、光に導ス イッチがサンプリングゲートとして作用し、時間で以内 でTHaフィルトのサンプリングを行う。

【0029】送信器を起動させ検出器をゲート制御する レーザバルスが同じ発射線から発起されるので、THz 過渡電流の全体は、可変の光遅れ回路26を用いてマッ ピングでき、これによって光伝導ゲートがTHz波面全 体にわたって移動する。

[0030] 図1に示す本売卵の実施所においては、T 上を遊送信器20と受信器22(検出器とも称する)と が、輸制液を売計添から検出器へ導を且つ欄財液を潜在 的に小ないサンブル上の駅近回折集東スポットへ集束す るイメージング楽子と共に光帯子配置10に相み込まれ 。図2に、送信器20及び検出器22の両方の構築に 用いられる光伝線ゲイボールアンテナ構築を示す。ここ では、検出器22の場合についてのみ具体的に述べる。 [0031] 検出器22はゲイボールアンテナ28から なり、ダイボールアンテナ28は、光伝導材料の基板3 0上に形成される1対のダイボール給電線28a及び2 8b、並びにオアションとして1対のダイボール腕部2 9a及び29bからなる。

【0032】基板30は、図2においては放射機処理したシリコン・オン・サフィイ構造(RD-SOS)からなる。2個のダイボール酸部の各々の合計寸法は一板に10~200μmの範囲にあり、これらの聴流の間に傾反は約5μmの緩の間能が延びる。アンテナ形成後、一般に0.6μm台の原そのシリコン層が、ダイボール値下の100×100平方μmの反域を除いてエッチングにより除去される。この構成によりアンテナの暗抵抗が増加し、検出器に対する維音器となり得る暗電流が減少する。

[0033] 時かりでは、ダイボールアンテナの光伝導 間隙32は非常に高低抗(約20Mの)である。レーザ バルスによるキャリヤの注入でこの抵抗は500Gより も低い確まで低下する。光ギャリヤの寿命中、受信され たTHェ電界の頻幅に比例する電流が流れる。下で述べ なおうに、この電流は、アンテナの給電線に接続された 電流増幅器34によって電圧に変換される。基板レンズ 36が自由空間からの入射TH z 輻射波をダイボールア ンテナ肉へ結合する。

[0034] 基版レンズ36は、本売明の光素千配置1 のに用いられる送信器及び受信器両方のゲイボールアン テナの重要な構成要素である。この基版センズがなけれ ば、自由空間外への結合が、基板表面間のスラブモード の随起によって制度される。又、基板レンズによって、 売割されて電磁解析波のコリメート処理の程度が進む。 加えて、このレンズは、ダイボールアンテナの倍率を上 げるように作用し、このことによってその効率が増加する。

[0035] 軒ましくは、符号36の基板レンスの誘電 率をその下の基板30の誘電率に一般させることによ り、基板とレンとをのインタフェース部における反射を 最小にできる。GaAs、サファイヤ、及びシリコンの 基板の場合、高版指のシリコンレンスが特に望ましい。 その理由は、高版指のシリコンは、THz 輻射接の吸収 が少なく、配析率が高波数と無関係であり、立ち品形構 造を有し、切断及び研造が容易だからである。

[0036]考え得る3種類の基板レンズ形状を図3 (A) - (C) にそれぞれ示す、図3 (A) において は、ダイボールアンデナ(図示せず)が在来のように基板30'の第1の表面31 aに設置される一方、基板レンズ36'が基板の第2の表面31 bに取り付けられる。レンズのサイズは直径にして2~10mm台である。

【0037】従来の技術で用いられる在来の設計(図3 (A))においては、ダイボールアンテナを有する発射 源(ダイボール発射源、又は簡単に、ダイボール)がレ ンズの焦点 f に設置され、全ての光線が基板に対して直 角の入射角でレンズから出る。例えば文献 (van Exter 8; Grischkowsky, IEEE Microw. Theor. Techn., vol38, 1648-1691, (1990)) を参照されたい。

【0038】この設計において、レンズはレンズ先端Tから距離hの位置で切断される。hは次式で与えられ

 $h = r(n_1/(n_1-1)) - (n_1/n_2) d$

ここに、rは球形基板レンズの半径、n₁ はレンズ指数 (屈折率)、n₂ は基板指数(屈折率)、dは基板の厚 さである。

【0039】基版のレンスと輻射改造信儀体である空気 とのインタフェース部でのビームの出口じとみ寸法中が 小さいので、固折効果によってTHェビームのコリメート処理が妨害され、結果として、より長い距離にわたっ でピームを、顕巻や光敏を及びの頭側を生じまることなく伝機することができず、THェビームを、従来の 技術において仮定されたような平行な原理動がビームに コリメートすることは確実に一可能でえる。

【0040】しかし、本売明者は、無財扱の発射器が無 継に近い成績であることから、別のレンズ形状を用いる ことにより、ビーム値径が削波数に依存し波面の湾曲が なくしかも限定回折サイズのスポット上に集束すること が可能であるような、平行な限定回折ビームが得られる ことを認動し、ことを認動し、

【0041】加えて、本等別報は、図3(A)のレンズ 形状において、輻射波が現時される発射円離角が、レン ズと自由空間とのインタフェース部における内部を反射 の角度によって限度されるという不具合点があることも 認識した。図3(A)のレンズ形状に対する最大円錐角 は次式で与えられる。

 $s i n \theta = (n-1)/(n^2-2n)$

ここに、 θ は円錐角の半分(半円錐角)、nは基板レンズの配析率である。

【0042】例よば照析率3.42 のシリコンレンズに 対する半円錐向は約30度である.光伝準グイボールか ら発射される輻射波の半円滑向は上配で等出される角度 よりも一般に大きいので(例えば45度)、ダイボール から発射される光の顕著な部分が内部全反射によって失 われることでなる。

【0043】ビーム直径が飛波数にほぼ無関係であり空 簡解像数が改善された、ほぼ平行なビーム、を後に達べ る仕力で得るのに用いられる。本発明に基づく差板レン ズの彫材は、図3 (B) に示すような半球形に設計され あ、基板レンスと空気とのイクタフェース部におけ 間折が生じないので、内部金反射に対する臨界角が存在 せず、したがってレンズの出口ひとみにおいて回角効果 は生じない。

【0044】この半球形レンズの設計仕様は基板レンズ 36''の中心Cがダイボールアンテナ(図示せず)の位 置にあるように定められる。基板の厚さを含めるため基 板レンズはレンズの先端Tから、次式で与えられる距離 hの位置で切断される。

 $h = r - (n_1/n_2) d$

【0045】本売明に基づく特に推奨される基板レンズの形状は、無球面収差の超半球形の形状であって、これを図3(C)に示す、この図3(C)の基板レンズの形状は、例えばレンズ及び欠は鏡の配置と組み合わせて、

村とど一ムを、波長寸法(例、300μm)に匹敵
する寸法の限定胆が気ボットへ集束するのに用いられる。半年形の設計と同様に、この設計は境面収差すなか ちコマ収差がなく、シリコンをレンズ材料として用いる 場合には色分散がない。

【0046】基板レンズは、レンズの先端Tから、次式で与えられる距離hの位置で切断される。

h=r[1+(1/n₁)]-d[{(n₁-n₂)/n₂]-1] ここに、rは基板レンズの半径 n₁ 及びn₂ はそれぞ れ基板レンズ36^{***} 及び基板30^{****} の有効屈折率で ある。

【○047】図3 (B)の中域形設計と対照的に、図3 (C)の無疎面改差で超半球形のレンズ形状ではどーム が僅かにコリメートされるので、このレンズ以外の残り の光システムをより高い1ナンバーの光学系で設計する ことが可能となる。この図3 (C)の形状においては、 レンズと自由空間とのインタフェース部での内部を反射 の臨界円錐角が十分大きいので、光伝導ゲイボールアン テナによって発射されたTHz 輻射波のはぼ全てを自由 空間と締合することができる。

[0048]上記の半球形及び超半球形のレンズ形状の 有用性を示す種々の実現所を、種々の光素予配置と組み 合わせた場合について次に間野に詳結する。図4-図7 は、図3(B)及び(C)の木発明に基づく新規の基板 レンズ形状と組み合わせて用いるたる種々の配置を示 す。前、これら種々の配置は砂示を目的に提示したに過 ぎず、いずれの基板レンズ形状も、例示のどの配置にも 使用できる。

【0049】本発明に基づき例えば、散物面の鏡(又は レンズ)が、送信(すなわち、発射)されて打足 観射 域を、対象周波数能囲(すなわち、100GHz~5T Hz)の変大は周波数に顕著には依存しないビーム直 径を有するほぼ平行なビームにコリメートするのに用い られる。光集東用の鏡(又はレンズ)が、このようにコ リメートされた平行ビームを、光システムの中心にある 限定回折スポット上へ集束するのに用いられる。レンズ と鏡との対称が配置が、打セ 輻射波を検出器上へ効率 よく截数するの配所いられる。

【0050】図4(A)は、図3(B)の無球面収差で 半球形の基板レンズ形状又は図3(C)の無球面収差で 超半球形の基板レンズ形状を用いてTHz輻射波のコリ メートされたビームを半途する。本発明に基づいて構築 された光配置例を示す。本発明に基づき、ビームBが、 少なくとも1個の光素子 (例示では単一のレンズ41) によって、ビーム直径が周波数にほぼ無関係であり波面 の湾曲がほぼない状態でより長い距離にわたって伝搬で きる平行な際室回析ビーム、にコリメートされる。

【0051】 南これに関していえば、液面の湾曲かなく ビーム商径が周波数に完全に依存するようなコリメート されたビームは、図3(B)の無球面収差の半販炉構成 によってのみ得られる。一方、図3(C)の構成での み、ビーム直径が周波数にほは無関係であり且・液面の 海血内程ないビームが得られる。「HLビームをコリメート及び/又は集束するのに要する光素子の開口数 は、図3(B)の形状に対しては、より大きくする必要 があるので、假して、無球面収差で超半球形の形状を用 いるのがより実際的であろう。

【0053】例示により説明すると、超半球形基板レン ズから放出される輻射波の全発射角すなわち円飾角は約 30度である。焦点距離6.6cmの漏心故物面鏡を用 いて、進条外線輻射波を、直径約25mmの、平行な限 宇间折ビームにコリメートすることができる。

(0054) このようなコリメートされたビームは、ビーム運栓が開放数に12球無関係で、ビーム運径したたって均質でない対象制又は質剤のスペクトル分析に対す、用である。又この形状によれば、コリメートされたビームを固折による観射波の損失なしに長い暗礁(少なくとも数m) にわたって伝播させることが可能になる。

【0055】これと対照的に、図3(A)の基板レンズ 形状を用いて従来の技術による構成では、放物面鏡40 及び42の間の間隔がその焦点距離の2倍であるときの み、最適の結合効率が得られる。上記の例では、この放 物面鏡の間隔は13.2 に mになる。

【0056】従来の技術による構成の別の欠点は、彼面 の消曲がなければTHzとしみが伝搬できないことであ る。例えば文献(Chevilite & Grischkowsky, Appl. Phy sicslett., vol 67, 1960-1962 (1990))を参照された ル、渡面の湾油でかい十二本を得ることは、例えば立 取り間間域反射率測定法におけるような、透過又は反 射されたTHz・電射波のタイミング解析に重要である。 ②00571尚、数物面燃料位置合わせが少し襲しい が、下14 2 輻射波の全範囲にわたって高い反射力と色収差補正動性とが鳴られる。代わりに、1 下H z よりも低い周波数では溶極石英レンズをそして最高10 FH z まではシリコンレンズを用いるようにしてもよい。しかし、可親レーザビームを用いる溶破石茶レンズの位置合わせは、层体率が可視用波数と下Hz 周波数とで非常に異なるので実施的でないことを注記したい。

易に理解されよう。

【0061】図6の配置においては、発射されたTHz ビームが送信器20の基板レンズから送出され、ビーム 直径が周波数にほぼ無関係であり且つ波面の湾曲がほぼ ないビーム、に放物面鏡44''によってコリメートされ る。図6に示すように、集束用レンズ48、又は代わり に別の偏心放物面(図示せず)を挿入することにより. ビームは更に、1 THzのビーク周波数において1 mm より小さい直径の限定回折スポット上へ集束される。 【0062】それから、例えばレンズ50と放物面鏡4 6''とからなる同様な光素子配置が、送信され集束され た輻射波を集光し受信器22上へ集束する。この配置で は、調査対象の契督(図示せず)に限定回折集東スポッ トSが得られ、これは、可能最小の集束スポットとな る。このような小サイズのスポット上へ集束できる能力 を、例えば高解像度イメージング用途(例: Nuss, IEEE Circuits and Devices, March 1996, pp.25-30) &, あるいは小サイズの物体の調査に用いることができるの

で有利である。 (0063) 広帯域THェイメージングにおいて、限定 回折スポットのサイズは輻射波の波具に反比例する。し たがって、THェグルへの高周波波面分の内容振伏的に 処理することにより、より高い空間無度変が得るがある。 (0064] 図7は、送信器20と機計器22との間の 光素予電配を変えた別の配置を示す。発射されたTHェ 輻射波が送信器20の基板レンズから送出され、レンズ 48°のような少なくとも1個の光素子によって受信さ 、 米倉地以上は優加上又は内砂度回折スポット上へ 集束される。次に、対象物又は媒質から反射された輻射 波が、レンズ50'のような第2の光素子によって集光 され受信器22トに集束される。

[0065] 南汉、与えられた用途に進した仕方でTL 電射被をコリメート及び/又は集束するために必要で おれば何個の光楽子を用いてもよい、更に、上記の実現 例全でにわたって対称的配置が示されているが、光素子 の非対称的配置が用っているたとは、この分野の当 業者には容易に確認できよう。

【0066】以上の説明は、本発明の一実施例に関する もので、この技術分野の当業者であれば、本発明の種々 の変形例を考え得るが、それらはいずれも本発明の技術 的範囲に包含される。

[0067]

【発明の効果】以上述べたごとく、本発明によれば、従来の技能において用いるれる光システムの、TH 2 機関 数取り扱いに際しての制約を支援することができる。す なわち、ビーム直径が用波数に無関係で、より長い距離 にわたって伝報できる平分に限定回折ビーム、を生成で き、被面の消命のない平行ビームと得ることができる。 基板レンズにおける総内部反射による実績失を防止でき る、又、広帯域のTH 2 輻射波を、限定回折集架スポットと人集束できる。

【0068】したがって、空間解傷度が空替され、TH 2分光学及びその他の調査手順に有用とて H 2 極射 接信 号を効率よく処理できる光システムが得られる、その結果、TH 2分光学及びイメージング等の与手法所管理が近 アロセス制御、パッケージ検査、水分分析、汚染測定、化学分析、ウエン特性特定、遠隔採並及び環境接著等の 飛艇が開始され

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に基づく光素子の配置を、限 定回折スポット上へ集束されたTHz輻射波を用いるイ メージング装置に使用された場合について示す。

【図2】図1の実施例に用いられる光伝導ダイボールアンテナ検出器構造の斜視図である。このアンテナ構造は 送信器と構造面で類似する。

【図3】図2に示すようなタイポールアンテナ構造に関連して用いられる3種類の基板レンズの開略図で、図3 (A)は、様本の技術によって一般に用いられる通常の基板レンズ、図3(B)は、本発明に基づき構築された光学都置に用いられる一基板レンズ、図(C)は、本発明に基づき構築された光学を置に用いられる別の基板レンズ、をそれぞれ示す。

【図4】本発明に基づき構築されて、TH z 輻射波を処理するように作動する光学配置の興略図である。これらのうち、図4 (A) は、図3 (B) 又は図3 (C) の形状の基板レンズによって自由空間かへ結合された直接のTH Z 輻射波を、ビーム直径が周波数にほぼ無関係であ

り変面の湾曲が4はない状態でより長い距離にわたって 伝微できる平行を限定回形で一人。にコリメートするよう に作動する光学配置を示す。図4 (B) は、コリメートされたTH 2 幅射波ビームを調査対象の頻繁に指向す ように作動する光学配置を示す。この場合、この輻射 波ビームのうちこの頻質を選して透過された輻射波ビームのうちこの頻質を関して透過された輻射波ビームが分が次に検出処理にかけられるように構成される。 「図5) 図5は、図4 (B) と同様に、本勢明と基づき 構築されて、TH 2 輻射波を処理するように作動する光 学配置の興略図であり、コリメートされたTH 2 輻射波 ビームを削波を頻繁にあるように作動する光 学配置の興略図であり、コリメートされたTH 2 輻射波 配置を示す。この場合、2 の輻射波ビームのうちこの蝶 質によって反射された輻射波ビーム部分が次に検出処理 にかけられるように構成される。

【図ら】 本発明に基づき構製されて日と報料款を処理するように作動する別の光学配置の頻略図で、図3(B) 又は図3(C)の形状の基板レンズによって自由空間内へ結合されて「日と幅財技を、別並対象の頻繁における、限定回所スポット上へ集率もように作動する光学配置を示し、この場合との輻射波ビームのうちこの媒質を選して遊過された部分が次に検出処理にかけられるように構成される。

【図7】本発明に基づき構築されて、THェ福射検を拠 埋するように作動する更に別の光学配置の頻略図で、図 3 (目) 又は図3 (C) の形状の基板レンズによって自 由空間がく結合されたTHエ報射波と、調査対象の媒質 に沿ける、脱定回折スポット上へ集束するように作動す な光学配置を示す、この場合この輻射後ビームのうちこ

[図1]

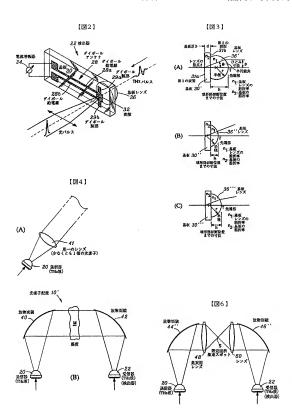
の媒質によって反射された部分が次に検出処理にかけら れるように構成される。

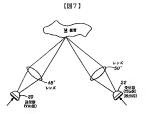
【符号の説明】

- 10、10′光素子配置
- 12 イメージング装置
- 14 発射源 (fsレーザ)
- 16 対象物
- 18 分析回路
- 20 THz波送信器(発射器)
- 22 THz波検出器(受信器)
- 26 光遅れ回路
- 27 コンピュータ
- 28 ダイボールアンテナ
- 28a、28b ダイポール給電線 29a、29b ダイポール腕部
- 294、290 ライホール映画 30.30'.30''.30'' 基板
- 31a (基板の)第1の表面
- 31b (基板の)第2の表面
- 32 間隙
- 34 電流增幅器
- 36、36'、36''、36''' 基板レンズ
- 40、42、44''、46'' 放物面鏡

【図5】

- 41 単一のレンズ
- 44' レンズ
- 46' レンズ
- 48 集束用レンズ 48'、50、50' レンズ





フロントページの続き

(71)出願人 596077259

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Je rsey 07974-0636U.S.A.